Research Paper 研究論》

Study on power estimation of PV module with Potential-Induced Degradation using EL image

Satoshi SAWADA^{*1‡} Sanshiro YAMANAKA^{*2} Yasuhiro AOYAMA^{*3} Yuki NISHIDO^{*3} Hiroshi KOBAYASHI^{*3}

EL 画像を用いた PID モジュールの出力推定に関する研究

澤田 賢^{'1 ‡} 山中 三四郎^{'2} 西戸 雄輝^{'3} 小林 浩^{'3} 青山 泰宏 *3

Abstract

Potential-Induced Degradation can be easily discovered by using EL images. Although it is possible to detect PID from EL images, it is necessary to perform IV measurement again to estimate how much the power of the mega solar is reduced by PID. The authors are investigating a method to quantitatively estimate the power from the EL image. In this study, we evaluated Rsh of the PID module on

a cell-by-cell basis and verified that the power could be estimated only by adjusting R_{sh} . Next, the correlation between the light emission from the EL image and R_{sh} was examined, and the power was estimated using R_{sh} estimated from the EL image. As a result, we were able to estimate the power with an error rate of about 3%. In addition, we found that the power can be estimated more easily by binarizing the amount of light emitted from the EL image and estimating R_{sh} .

Keywords: Photovoltaic cell, Potential-Induced-Degradation, EL image, Shunt resistance (Rsh), power estimation, **キーワード**: 太陽電池, PID 現象, EL 画像, シャント抵抗(R_{sh}), 出力推定

1. はじめに

太陽光発電システム(以下,PVS)は固定価格買取制度(Feedin-Tariff,以下 FIT)の導入により制度開始後3年間で大量導 入されるに至った(1). 太陽光発電は当初メンテナンスフリー と言われていた(2). しかしながら, 近年, 出力低下(3)や火災(4) などの不具合が報告されるようになり,2017年4月に改正FIT

法の施行により、保守点検・維持管理が義務化された(5-0)、太 陽電池の不具合の一例として電圧誘起出力低下(Potential Induced Degradation, 以下 PID) 現象が挙げられる(7-8). PID 現象 は高温多湿の気候地域で設置されたPVSで観測されることが 多い⁽⁹⁾. 太陽電池モジュール (以下 PV モジュール) のフレー ム・ガラスと、セル間の電位差によるセル表面への電荷蓄積 (10)や、ガラスに含まれる Na+がセルへ移動すること等が原因

*1 名城大学大学院 理工学研究科 (〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口 1-501) t e-mail: 140442063@ccalumni.meijo-u.ac.jp 現在 愛知時計電機株式会社 勤務

^{*1} Graduate School of Science and Engineering, Meijo Univerity, 1-501 Shiogamaguchi, Tenpaku-ku, Nagoya 468-8502, Japan

t e-mail: 140442063@ccalumni.meijo-u.ac.jp *2 Professor, Science and Engineering, Meijo Univerity

^{*3} TOENEC CORPORATION

Received: Nov. 26th 2019, Accepted: Apr. 8th 2020

^{*2} 名城大学理工学部 教授

^{*3} 株式会社トーエネック

⁽原稿受付:2019年11月26日,受理日:2020年4月8日)

で発生する.この現象により出力が大幅に低下することが報告されている⁽⁸⁾.しかしPID現象の発生したPVモジュールは外観の変化が見られないことも多く,目視では発見することが困難である.

そこで現在では PID 現象を診断する有効な方法の一つとし て EL 画像を用いた点検方法がある. EL 画像では PID 現象が 発生している場合,セル単位の暗部として検出することがで きる.そのため目視点検では発見が困難であった PID 現象を, EL 画像を用いて発見することが可能となった^(8,11,12).

これまで EL 画像を撮影するには PV モジュールを架台か ら外し, 暗室で1枚ずつ撮影を行う必要があった.しかし EL 撮影用のドローンが開発され,上空から大量の PV モジュー ルを一度に撮影できるようになり,測定の効率化が可能とな っている⁽¹³⁻¹⁵⁾.しかし,現場での EL 画像を用いた診断は PID 現象の発見にとどまり,経済的な損失につながる PVS の出力 低下を定量的に評価するには I-V 測定等により再検査する必 要がある. Bedrich らは, EL 画像を用いた出力推定方法を提案 している⁽¹⁶⁾.この提案は精密に補正された 2枚の EL 画像が 必要であり,現場で簡便に活用できるまでには至っていない.

著者らの研究室では、ドローンを用いて上空から EL 画像の撮影を行い、PV モジュールの PID 現象を発見するだけでなく、出力低下を定量且つ簡便に推定する方法を検討している. PID 現象は短絡電流 (*I*₈)等、他の電気パラメータと比べセルのシャント抵抗(以下 *R*₃)が先行して低下することが報告されている^(8,11).また、筆者らのこれまでの研究より、EL 画像のセル単位の輝度の低下とセルの *R*₃h は密接に関係していることが明らかとなっている⁽¹⁷⁾.そのため、EL 画像のセル 1 枚毎の輝度の低下からセル毎の *R*₃hを推定し、PV モジュールの I-V 特性をシミュレーションにより算出することで、PID 現象による出力低下を EL 画像 1 枚から推定できると考えている.

本論文では、最初に PID 現象の発生した PV モジュールの R_{sh}をセル単位で評価し、R_{sh}の調整のみで出力を推定可能であ ることを検証する.次に EL 画像の輝度と R_{sh}の相関性を検討 し、EL 画像を用いた出力推定を試みる.最後に EL 画像を2値 化し、より簡便に出力を推定する方法について提案する.

2. I-V 特性とセルの Rsh

本章では PID 現象によって R_{sh}のみが低下し I_{sc}等の他の電 気パラメータは正常と仮定して検討を進める.そのため最初 に,PID 現象の発生した PV モジュール 2枚(Mo.A, Mo.B)に 対してセル単位で R_{sh}の評価を行う.これまでに, Roy らは EL 画像を用い R_{sh}を定量的に評価する研究⁽¹⁸⁾を行なっている.し かしこの研究では PV モジュールの出力に影響を及ぼすほど R_{sh} が低下した場合の検討は行なわれていない.本論文では, R_{sh}が大きい場合は実測の I-V 特性より評価し, R_{sh}が小さい場 合は I-V 特性のシミュレーションより推定することで全セル の R_{sh}を定量的に評価した.次に,得られた R_{sh}に基づいて I-V 特性をシミュレーションにより推定し,実測値と比較した.

2.1. I-V 特性から評価したセルの Rsh (Rsh が大きい場合)

本論文では Fig.1 に示す多結晶シリコン型,3 クラスタ,セ ル枚数 60 枚の PV モジュールを使用した. Table.1 に PV モジ ュールの公称値を示す.

非破壊でセルの R_{sh}を測定する方法として、セル1枚を半透 過フィルムで遮光した際の PV モジュールの I-V 特性を利用 する方法がある⁽¹⁹⁾. Fig.1 に R_{sh}測定時の実験回路図を示してい る.測定では対象セル1枚を遮光率 50%のフィルムで遮光した 状態で I-V 特性の測定を行った. Fig.2 に測定結果の例を示す. ただし日射条件の違いを考慮しグラフの形状を比較し易くす るため、電流は I_{sc}で、電圧は開放電圧(V_{co})で規格化している. 正常な発電状態にあるセルは、セル1枚を遮光すると1クラ スタ分の電流が制限されるため Fig.2 の①のように段差のあ る I-V 特性となる. この時, Fig.2 に示す(a)-(b)の区間に遮光し たセルの逆バイアス領域の特性が現れるため, (a)-(b)間の傾き の逆数の絶対値から R_{sh}を算出する.

Fig.3 に I-V 特性から評価したセルの R_{sh} を示す. Fig.3 は全 てのセルに対し 1 枚ずつ遮光した状態で I-V 測定を行い, 測 定した I-V 特性の(a)-(b)間の傾きを, 最小二乗法を用いて R_{sh} を評価した. 図中の空欄は R_{sh} が小さすぎて本手法では算出で きなかったセルである. 本検討では 2 枚の PV モジュールを 用いて調査したが, Fig.3 は例として PID 現象がより進行して いる Mo.B の結果を示した. Fig.3 の結果より本手法にて得ら れた R_{sh} の最低値は 4 Ω であった. PID 現象により R_{sh} が 4 Ω 以 下まで低下した場合, Fig.2 の②, ③のような I-V 特性となる. これは R_{sh} の低下により(a)-(b)間の傾きが大きくなるためであ る. ①の I-V 特性では(a)-(b)間に直線性が得られるが, ②, ③ の I-V 特性では(a)-(b)間に直線性が得られるが, ②, ③



Table 1Nominal value of used module表 1. 使用した PV モジュールの公称値

I _{sc} [A]	$V_{\rm oc}[{ m V}]$	P_{\max} [W]	FF
8.54	37.0	240	0.76



Fig.2 I-V characteristics of PV module with a shaded cell. 図 2 セルの遮光した際の I-V 特性の例

16	25						14		7
	107		88	98	14	122	104	139	6
5		11		11	19	4	19		10
	225	4	110	77	67	62	85	29	7
6	4	5	7	8	106	59	55		
	8	41	165	143	104	50	4		7

Unit: [Ω]

Fig.3 R_{sh} of cell evaluated from I-V characteristics 図 3 I-V 特性から評価したセルの R_{sh}

2.2. FF を利用した R_{sh}の評価(R_{sh}が小さい場合)

Fig.2 の②, ③セルの R_{sh} はいずれも 4 Ω以下である. しかし ②, ③の I-V 特性の形状には違いがあり, ②のセルに対し(a)-(b)間の傾きがより急である③のセルは R_{sh} がより低下してい ると考えられる. また Fig.2 の■印は①~③の I-V 特性の最適 動作点を(P_{max})の位置を示しているが, STC 条件では I_{sc} , V_{cc} が 同じであるため R_{sh} の低下に伴い*FF*が増加することがわかる. そこで著者らは R_{sh} が 4 Ω以下のセルを対象に, *FF* から R_{sh} を 推定する方法を検討した. 本節では, 最初に *FF* を規格化した *FF* norm を導出した. その後, シミュレーションを用いて *FF* norm と R_{sh} の関係を求めた. 最後に, R_{sh} が 4 Ω以下のセルの R_{sh} を *FF* norm と R_{sh} の関係から推定した.

セルの R_{sh} の低下が進むにつれて対象セルは短絡状態に近 づく. そのため実測において遮光したセルの R_{sh} が低下してい る場合, FF はセルを遮光していない状態の FF の値に近づく. しかし,遮光していない状態の FF は PV モジュールの状態 (PID の有無等)によって異なる.本検討で用いた PID モジュー ルの FF は非遮光状態で 0.60 であった. そのため,セルの R_{sh} を低下させた時,正常な PV モジュールでは FF が 0.60 以上 になる場合でも PID モジュールでは FF が 0.60 で頭打ちとな る. 従って, FF から R_{sh} を推定すると, R_{sh} は本来推定すべき値 よりも高く推定されてしまう可能性がある. そこで本検討で は FF の値を直接用いず, FF を規格化した FF nom を用いて R_{sh} との関係を比較した.式(1)に FFnomの算出式を示す.ただし FFiは対象セルを 50%遮光したときの FF, FFminは対象セルを 50%遮光した R_{sh} =100 Ω の時の FF, FFmaxはセルを遮光してい ない状態の FF とする.FFnomはセル遮光時の FF が,遮光して いない時の FF にどれだけ近い値であるかを百分率で表して いる.

$$FF_{norm} = \frac{FF_i - FF_{min}}{FF_{max} - FF_{min}} \times 100 \qquad \cdots (1)$$

次に 2.1 節で用いた PID モジュールを想定してシミュレー ションを行った⁽²⁰⁾. シミュレーションには回路シミュレーシ ョンソフトの P-spice を使用した. P-spice はソフト上で電気回 路を組み、その回路の電気特性をシミュレーションするソフ トである. PV モジュールの等価回路はセル枚数 60 枚,3 クラ スタ構成の PV モジュールを想定し、Fig.1 に示すようにバイ パスダイオードを含めた PV モジュール全体の等価回路を Pspice で作成した. また, セル1枚の等価回路を Fig.4 に示す. Table.2 に P-spice のシミュレーションで用いたセルの各パラ メータを示す. 出力推定では I-V 特性の第一象限を決定する パラメータを設定する必要がある. Table.2 に示したパラメー タはPVモジュールの公称値を参考とした. しかし, 太陽電池 は公称出力の誤差±10%まで許容されており、実測値と公称 値のIsc, Vocが異なる場合がある.従ってIsc, Vocは、型番が同じ で PID 現象の発生していない正常な PV モジュールから実測 した I-V 特性をフィッティングし, 設定値として用いた. ただ し, R_sは十分に小さい値と仮定し 0.008Ωと設定した. またセ ルの Rth は新品の PV モジュールの場合 20Ω以上の値をとる ⁽²¹⁾. そのため, R_{sh} は出力に影響を与えないほど十分に大きい と仮定し100Ωと設定した.

シミュレーションではセル1枚を遮光率50%で遮光した状態を再現するためセル1枚の I_{sc} を50%低下させた.その後 I_{sc} を50%低下させたセルの R_{sh} を100 Ω ~0.001 Ω の範囲で調整し, I-V 特性を算出した.得られた I-V 特性から FF_{norm} を算出し, FF_{norm} を算出した.

Fig.5 は R_{sh} と FF_{norm} の関係をシミュレーションにより求め た結果である. Fig.6 は R_{sh} が 10 Ω以下のセルにおける FF_{norm} の計算結果を示している. R_{sh} が 0.01 Ωよりも小さい場合, FF_{norm} はほぼ 100%の値をとる. R_{sh} が増加すると FF_{norm} は減少 し, R_{sh} が 4.5 Ωで FF_{norm} は 0.3%となる. R_{sh} が 4.5 Ω以上の場合, FF_{norm} は 0.3%以下の値をとり,小さな値になった.以上より, R_{sh} が 0.01 Ω~4.5 Ωの範囲で R_{sh} と FF_{norm} に相関性が得られる ことがわかった. そのため, R_{sh} が小さいセルは FF_{norm} から R_{sh} の 値を推定することとした. 式(2)に Fig.5 の FF_{norm} と R_{sh} の関 係から R_{sh} が 0.01 Ω~4.5 Ωの範囲で近似曲線を算出した結果 を示す. ただし, x はセルの FF_{norm} y は R_{sh} を示す.

 $y = -4.15x^3 + 9.77x^2 - 10.14x + 4.47 \quad \dots (2)$



Fig.4 simulation model 図4 シミュレーションモデル

Table 2Cell parameters used in P-spice simulation表 2P-spice のシミュレーションで用いたセルの各パラメ



実測においてセルの R_{sh} が 4 Ω 以下 (Fig.3 の空欄)の場合, セル 1 枚を 50%遮光した実測の I-V 特性の FF から FF norm を 式(1)より算出し,その後,式(2)に FF norm を代入することで R_{sh} を算出した. FF norm を算出する際に, FF nim は PV モジュール内 の全セルにおいて最も小さい FF を FF min と設定した.また FF max はセルを遮光していない状態の I-V 特性から得られた FF を FF max と設定した. Fig.6 に例として PID 現象がより進行 している Mo.B の FF norm をセル毎に算出した結果を示す. Fig.3 の結果より R_{sh} が 4 Ω 以上であり I-V 特性から R_{sh} を算出でき る場合は FF norm から推定する必要がないため「一」で示した. Fig.6 に示したように実測では測定時間の差異による日射強 度や気温の変化により FF norm が 100%をわずかに超える場合 がある.シミュレーションでセルの R_{sh} をどれだけ低下させて も FF norm は 100%を超えることはない.従って FF norm が一定以 上の値となる場合, R_{sh} の下限値を決定する必要がある.

そこで、Mo.Bの結果を用いRshの下限値を、シミュレーショ

ンを用いて検討した.シミュレーションは3クラスタ,セル 枚数60枚を想定し、セル1枚の等価回路はFig.4に示したモデ ルを使用した.パラメータはTable 2で示した値を用い、 R_{sh} の値のみセル毎に算出した結果を代入した. R_{sh} が4 Ω 以上の セルはFig.3の結果を用いた.また R_{sh} が4 Ω 以下の場合は FF_{norm} を式(2)に代入して得られた R_{sh} を使用し、設定した下限値を 下回る場合のみ R_{sh} の下限値の値を代入した. R_{sh} の下限値につ いては1 Ω ,0.1 Ω ,0.01 Ω ,0.001 Ω 04パターンとし、シミュレ ーションから算出したI-V特性が、実測時のI-V特性に最も近 い値を下限値と設定した.

Fig.7 に R_{sh} の下限値を変化させた時の I-V 特性と実測時の I-V 特性を比較した結果を示す.Fig.7 より R_{sh} の下限値が 0.1 Q の時,実測値に最も近づくことがわかった.Fig.5 の関係より R_{sh} が 0.1 Qに対応する FF_{norm} は 93%である.従って本検討で は FF_{norm} が 93%以上の場合, R_{sh} を 0.1 Qに統一し推定を行っ た.

Fig.8 に Mo.B において R_{sh} が 4 Ω以下のセルに対して FF_{norm} を用いて R_{sh} を算出した結果を示す. FF_{norm} を用いて算出した セルは灰色で表している. 白色のセルは Fig.3 で得られた結果 を示している. 以上より 2.1 節の手法と本節で提案した手法 の結果を合わせることで全てのセルの R_{sh} を定量的に評価で きることがわかった. また Fig.9 に Mo.B と同様の方法により 推定した Mo.A の R_{sh} の結果を示す.

-	-	55%	75%	69%	78%	77%	-	98%	·-
101 %	-	68%	-	-	-	-	-	-	-
•	87%	-	79%	•	-	-	-	92%	-
97%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	89%	98%
101 %	-	-	-		-	-	-	101 %	-

Fig.6 Calculation results of FF_{norm} 図 6 FF_{norm} の算出結果





16	25	1.15	0.6	0.76	0.54	0.56	14	0.1	7
0.1	107	0.77	88	98	14	122	104	139	6
5	0.30	11	0.49	11	19	4	19	0.18	10
0.1	225	4	110	77	67	62	85	29	7
6	4	5	7	8	106	59	55	0.26	0.1
0.1	8	41	165	143	104	50	4	0.1	7

Unit: [Ω]

Fig.8 Results of evaluating *R*_{sh} of Mo.B 図 8 Mo.B の *R*_{sh} の評価結果

95	29	0.47	0.56	41	0.3	0.14	0.1	0.56	0.1
0.1	16	175	7	7	5	4	16	0.12	205
6	0.62	27	4	145	122	122	6	153	0.1
0.1	149	64	56	75	263	167	57	8	222
26	38	260	212	153	215	16	18	76	0.56
92	164	217	7	110	7	15	18	6	0.19

Unit: [Ω]

Fig.9 Results of evaluating R_{sh} of Mo.A 図 9 Mo.A の R_{sh} の評価結果

2.3. Rsh を用いた出力推定

本節ではPIDモジュール(Mo.A, Mo.B)各セルのR_{sh}をパラメ ータにしたI-V特性のシミュレーション結果と実測で得られ たI-V特性の比較を行なった.シミュレーションは3クラスタ, セル枚数60枚を想定し, Fig.1に示すようにバイパスダイオー ドを含めたPVモジュール全体の等価回路をP-spiceで作成し た.またセル1枚の等価回路はFig.4に示すモデルを使用し た.パラメータはTable 2で示した値を用い, R_{sh}の値のみセ ル毎に算出した結果を代入し, I-V特性をシミュレーション した.

Fig. 10 は Mo.A について Fig.9 で得られた R_{sh}に基づいて計 算された I-V 特性のシミュレーション結果と実測した I-V 特 性を比較したものである. I-V 特性を実測した時の日射強度は 999[W/m²]であった. 出力の絶対誤差率は 2%, FF の絶対誤差 率は 2%であった.

Fig.11 は Mo.B について Fig.8 で得られた R_{sh}に基づいて計 算された I-V 特性のシミュレーション結果と実測した I-V 特 性を比較したものである. I-V 特性を実測した時の日射強度は 1090[W/m²]であった. 出力の絶対誤差率は 1%, FF の絶対誤差 率は 0%であった.

本検討において Mo.A の I-V 特性の推定では Fig.7 に示すように, Mo.B の I-V 特性にフィッティングして設定した *R*_{sh}の下限値を用いた.だが, Mo.A, Mo.B いずれの場合においても実測値に近い I-V 特性を再現できることが分かった.また PID モジュールのシミュレーションでは, *R*_{sh}のみを低下させ,



Fig.10 Comparison of the measured values of Mo.A and the I-V characteristics simulated using $R_{\rm sh}$





Fig.11 Comparison of the measured values of Mo.B and the I-V characteristics simulated using *R*_{sh}

図 11 Mo.B の実測値と R_{sh}を用いてシミュレーションした I-V 特性の比較

他の電気パラメータは正常と仮定したが実測値に近い結果を 得られることがわかった.以上より PID モジュールの出力を 推定する方法としてセルの *R*_{sh} を調整して I-V 特性を再現す る手法は妥当であることがわかった.

3. EL 輝度を用いた出力推定

2章ではセル毎に R_{sh}を測定し, R_{sh}の調整のみで I-V 特性を 再現できることを確認した.本章では, EL 画像の輝度と R_{sh}の 相関関係について検討した.その後, EL 画像を用いて I-V 特 性の推定を試みた.

EL 画像の撮影の際には PID モジュールに電流源(Kikusui PAS 60-12)を接続し 8A の電流を印加することで, PID モジュ ールから近赤外光を発生させた. この PID モジュールの発光 状態を EL 画像撮影用のカメラで撮影を行った. 撮影時のカ メラの設定は F 値を 4.0, シャッタースピード 5sec, ISO 感度 を 800 とし, 撮影した EL 画像がハレーションの起こらない 条件に設定した. また撮影は外部からの光の影響を防ぐため に暗室内で行った.

EL 画像のセル毎の輝度は画像処理ソフト (GIMP2.8.20) を 用いて算出した. EL 画像に対しセル1枚毎に範囲指定し, セ ル内の輝度の平均値を求めることでセル毎の輝度を算出した. また測定環境の変化を考慮するため, 本検討では PV モジュ ール内の最大輝度のセルを基準として, 各々のセルの輝度を 百分率で表した.

Fig.12 に撮影した EL 画像を示す. Fig.13 に輝度と R_{sh}の関係 を示す. グラフの破線は輝度 50%を示している. 輝度が 50% 以上の場合, ばらつきが大きく輝度と R_{sh}の相関性を得られな いことがわかった. ばらつきの原因としては口径食やセルの 量子効率の違い⁽¹⁶⁾等が考えられる. 輝度が 50%を下回る場合, R_{sh}は1Ω以下に低下していることが確認できる. また,輝度が 50%以下の結果を用いて輝度と R_{sh}の相関係数を算出したと ころ 0.87 であった. 以上より輝度と R_{sh}に強い相関があるこ とが確認できた.

これより Fig.13 の輝度と R_{sh}の関係を元にセルの輝度か ら R_{sh}を推定する式を導出する.輝度が 50%以上の場合,輝度 と R_{sh}の相関性は得られない.そのため輝度が 50%以上のセ ルは漏れ電流が流れないほど R_{sh}が大きいと考え,一律 100Ω とした. Fig.14 に Fig.13 の輝度と R_{sh}の関係について 50%以下 の部分を拡大した結果を示す.輝度が 50%以下の時,輝度と R_{sh}の関係は直線であるとし,一次式で関係式を導出した.一 次式の妥当性については後程改めて評価する.式(3)に輝度と R_{sh}の関係式を示す.ただし,x は輝度,y は R_{sh}を示す.

y = 0.791x + 0.003 ... (3)

(a)Mo.A
 (b)Mo.B
 Fig.12 EL image of PID module
 図 12. PID モジュールの EL 画像



Fig.13 Correlation between brightness of EL image and $R_{\rm sh.}$





図 14 輝度が 50%以下の EL 輝度と R_{sh}の関係

Fig.15 に Mo.A の EL 画像の輝度から推定した R_{sh} の結果を示す. 輝度が 50%以下であり式(3)から R_{sh} を推定したセルは グレーで示した.また Fig.16 に実測により得られた I-V 特性 と Fig.15 で得られた R_{sh} に基づいて計算された I-V 特性のシミュレーション結果を示す.ただし, R_{sh} の推定結果が 0.1 Ω以 下のセルは 0.1 Ω と推定した.実測の I-V 特性では日射強度 1,090[W/m²]の条件で測定した.Fig.16 の●印はそれぞれの最 適動作点を示している.参考として FF の絶対誤差率を算出 したところ 3%であった.また出力の絶対誤差率は 4%であった.

Fig.17 に Mo.B の EL 画像の輝度から推定した R_{sh}の結果を 示す.輝度が 50%以下であり式(3)から R_{sh}を推定したセルは グレーで示した.また Fig.18 に実測より算出した I-V 特性と Fig.17 に基づいたシミュレーションより算出した I-V 特性を 示す. Fig.18 の●印はそれぞれの最適動作点を示している.実 測の I-V 特性では日射強度 998 [W/m²]の条件で測定した.参 考として FF の絶対誤差率を算出したところ 2%であった. また出力の絶対誤差率は 3%であった.

EL 画像を用いた推定では、輝度 50%以上のセルをすべて R_{sh} が 100 Ω として推定した.しかし Fig.16, Fig.18 の結果より Mo.A, Mo.B 共に I-V 特性の形状をおおむね推定できた.以上 の結果より R_{sh} が大きい場合, I-V 特性の形状は R_{sh} の値に依存 せず, R_{sh} が小さいセルのみ EL 画像から R_{sh} を推定することで I-V 特性を再現できることがわかった.また, Fig.14 において 輝度と R_{sh} の関係を式(3)で近似している.式(3)を使った近似 でも I-V 特性が精度よく推定できており,式(3)を使った近似は 妥当であると考えてよい.

100	100	0.37	100	100	0.36	0.20	0.19	0.38	0.1
0.1	100	100	100	100	100	100	100	0.23	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.12
0.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.15

Unit: [Ω]

Fig.15 *R*_{sh} estimated using Mo.A EL image







図 16 Mo.A の実測値と EL 画像から推定した I-V 特性の 比較

100	100	100	100	100	100	100	100	0.12	100
0.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	0.36	100	100	100	100	100	100	0.21	100
0.1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	0.30	0.1
0.1	100	100	100	100	100	100	100	0.1	100
								Unit	: [Ω

Fig.17*R*sh estimated using Mo.B EL image図 17Mo.B の EL 画像から推定した *R*sh





4. 簡易的な出力推定に関する検討

3章では輝度と R_{sh}の相関について検討し、輝度が 50%以 下のセルの R_{sh}を EL 画像から推定することで出力推定が可 能であることが明らかとなった.しかし出力推定を行うには Fig.14 の関係から推定式を求める必要があり、実用的な方法 とは言い難い.従って本章では現場で使用する実用的な方法 として、輝度と R_{sh}の推定式を必要としない簡便な出力推定 方法について提案する.

3章では EL 画像の輝度が 50%以上の時 100 Ω とし輝度が 50%以下のセルに対してのみ, R_{sh} の推定を行った. Fig.15, Fig.17の灰色で示したセルは輝度が 50%以下のため R_{sh} を推定式より算出を行ったセルを示しているが, いずれのセルも 0.1 Ω ~ 0.4 Ω であることが分かった. そのため,本章では EL 画像からより簡便に出力を推定する方法として,輝度が 50% 以上のセルを 100 Ω ,輝度が 50%以下のセルの R_{sh} を 0.1 Ω と 2 値化し R_{sh} の推定を行った. その後得られた R_{sh} に基づい て I-V 特性のシミュレーションを行い, I-V 特性の形状およ び P_{max} について検討した.

Mo.A の R_{sh} を 2 値化した結果を Fig.19 に, Mo.B の R_{sh} を 2 値化した結果を Fig.20 に示す. I-V 特性は Mo.A, B いずれのシ ミュレーション結果においても実測値との差が大きくなって いる. これは R_{sh} を 0.1 Ω と低く見積もったことが原因と考え られる. しかし, Mo.A の出力の絶対誤差率は 2%, FF の絶対誤 差率は 3%, Mo.B の出力の絶対誤差率は 1%, FF の絶対誤差 率は 1%であり, R_{sh} を精密に推定した時の絶対誤差率とあま り変わらない結果となった.

Table.3 は正常な PV モジュールの実測値に対する出力低下 率を, I-V 特性の実測値及び EL 画像から簡易的に求めた結果 を比較したものである.環境条件については、Mo.A は日射強 度 916[w/m²], Mo.B は日射強度 863[w/m²]で測定を行った.ま た正常な PV モジュールは各 PID モジュールの測定直後に測 定し,各 PID モジュールと同じ日射強度で I-V 特性を測定し た.I-V 特性と, EL 画像から簡易的に推定した時の出力低下率 の差はMo.A, Mo.B, いずれの場合も3 ポイント以下であり,+ 分小さいことが分かる.



Fig.19 Simulation result of binarized Mo.A

図 19 Mo.A を 2 値化した時のシミュレーション結果





Table 3 Comparison of power reduction rate measured by each inspection method.

	I-V charactrastics	EL image
Mo.A	80.2%	79.9%
Mo.B	79.4%	81.9%

表3 各検査方法から測定した出力低下率の比較

5. まとめ

本報告では PID 現象が発生した PV モジュールの R_{sh} を評価し R_{sh}の調整のみで出力推定が可能か検討した.その後 EL 画像の輝度と R_{sh}の関係について相関性を調査し, EL 画像から出力を簡便に推定する方法について検討した. 以下にその結果をまとめる.

- PID 現象によって R_{sh}が低下したセルは I-V 特性から直接 R_{sh}を評価することができない. それらのセルは FF を用いて R_{sh}を推定することで定量的に評価することができる. 上記の方法で得られた R_{sh}を用いてシミュレーションを行うことで PID モジュールの I-V 特性を再現可能である.
- (2) 輝度が 50%以下の場合に限り, 輝度と R_{sh}の相関が得られる. 輝度が 50%以上の場合, R_{sh}は推定できないが十分に大きい値であるため R_{sh}を一律 100Ωと推定しても I-V 特性の形状にほぼ影響はない. 従って輝度が 50%以下に低下したセルのみ EL 画像から R_{sh}を推定することで PID モジュールの I-V 特性を再現可能である.
- (3) 50%以下のセルの R_{sh}をすべて 0.1Ωと推定しシミュレーションを行うことで絶対誤差率 3%以内で出力を推定することができる.すなわち, EL 画像の輝度を2値化して R_{sh}を推定することでより簡便に出力を推定することができる.

現場での診断ではアレイ単位の出力推定を要求される.本 報告にて提案した手法を用いて PID モジュールの I-V 特性を EL 画像から推定し,正常な PV モジュールの I-V 特性と合成 することで,アレイ単位の出力推定が可能である.従って本 報告より PID 現象による PVS の出力低下を EL 画像から推定 可能になると考えている.

ただし、本論文では2枚の同種のPID発生モジュールを用いて出力推定方法を提案している.提案の手法で出力推定を 実用化するためには異種モジュールにおいても本論文で提案 した推定方法が適応可能か今後検討を進める必要がある.

また、本論文では EL 撮影についても撮影条件を限定して いる.特に、ドローンを用いた EL 検査では本論文で使用した カメラの設定では撮影が難しい.そのため今後は、ドローン で撮影した EL 画像を分析するために、カメラの撮影条件の 検討や *R*_{sh}、輝度をパラメータとした感度分析を行い、より汎 用性の高い出力推定方法の検討を進める予定である.

6. 参考文献

1) 経済産業省 資源エネルギー庁,再生可能エネルギー固定価格買取 制度ガイドブック 2018 年度版,2-5 (2018),経済産業省,東京.

2)浜川圭弘, 桑野幸徳共編, アドバンストエレクトロニクス 1-3 太陽 エネルギー工学 太陽電池, 10-12 (1994), 培風館, 東京

3)加藤和彦,太陽光発電システムの不具合事例ファイル,12-14 (2010), 日刊工業新聞社,東京.

4) 消費者安全調查委員会,消費者安全法第23条第1項の規定に基づ く事故等原因調査報告書(住宅用太陽光発電システムから発生した火 災事故等), 10-12 (2019), 消費者庁, 東京.

5)経済産業省, 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関 する特別措置法, (2016).

6) 資源エネルギー庁,事業計画策定ガイドライン(太陽光発電),21-30
 (2019).経済産業省,東京.

7)大内雅之,太陽電池モジュールの検査方法と不具合事例,電気設備 学会誌 37 (6), 346-349 (2017).

 W. Luo et al., Potential-induced degradation in photovoltaic modules: a critical review, Energy Environ. Sci., 43 (10), 43-68 (2017)

9) Y. Chen et al., Investigation of Correlation between Field Performance and Indoor Acceleration Measurements of Potential Induced Degradation (PID) for c-Si PV Modules, 33rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (2017), 1408-1413, Amsterdam, Netherlands

 Naumann V., Geppert T., Großer S., Wichmann D., Krokoszinski H., Werner M., Hagendorf C. Potential-induced Degradation at Interdigitated Back Contact Solar Cells. Energy Procedia, 55, 498-503 (2014)

11) 土井卓也,新規信頼性試験法の開発,第Ⅱ期高信頼性太陽電池 モジュール開発・評価コンソーシアム最終成果報告書,227-255 (2013). (accessed:Nov.1st2019)https://unit.aist.go.jp/rcpv/ci/results/past_presentation/ 2013module_consortium/4_3.pdf

12) Xianfang Gou, Xiaoyan Li,1 Su Zhou, Shaoliang Wang, Weitao Fan, Qingsong Huang, PID Testing Method Suitable for Process Control of Solar Cells Mass Production, International Journal of Photoenergy Volume 2015, (accessed:Nov.1st2019)<u>https://www.hindawi.com/journals/ijp/2015/863248/</u> 13) 西戸雄輝,青山泰宏,ドローンを活用した太陽電池のEL測定診断, 電気現場,**57**(668),70-73(2018).

14)西戸雄輝,太陽光発電設備のオンサイト EL 測定,電気設備学会誌 39(11),708(2019).

15)西戸雄輝, 青山泰宏, 太陽光発電設備のメンテナンス用ドローンの 開発, ロングライフビル推進協会会誌, **31**(168), 35-38 (2019).

16) K. G. Bedrich et al. Quantitative Electroluminescence Imaging Analysis for Performance Estimation of PID-Influenced PV modules IEEE J. Photovolt, 16 (8), 669-77 (2018)

17) S. Sawada, Kentaro HADA, TAKESHITA Ryuichiro, Sanshiro YAMANAKA, Yasuhiro AOYAMA, Yuki NISHIDO, Hiroshi KOBAYASHI, Correlation between brightness of EL image and Rsh of PV module with hot spot, Institute of Electrical Installation Engineers of japan, (2017), C-20, Ehime, Japan

 S. Roy and R. Gupta, Quantitative Estimation of Shunt Resistance in Crystalline Silicon Photovoltaic Modules by Electroluminescence Imaging, IEEE J. Photovolt, 9 (6), 1741-1747 (2019)

19) S. Yamanaka, T. Mishina, H. Kawamura, H. Kawamura, H. Ohno, K. Naito, Effect of the Reverse Bias Characteristics of a PV Cells on I-V Characteristics of PV Module with a Cell Lowered the Generating Power, JSES, 29 (2), 44-52 (2003).

20)Volker Quaschning and Rolf Hanitsch, Solar Energy, **56** (6), 513-520 (1996).

21)Hiroki SATO, Sanshiro YAMANAKA, Yasuhiro AOYAMA, Yuki NISHIDO, Hiroshi KOBAYASHI, Study on Evaluation Method of Shunt Resistance Reduction of Photovoltaic Cell Using Thermal Images, Jornal of Japan Energy Society, **44**(6), 73-79 (2018).